

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 10 月 13 日 (2005.10.13)

【公開番号】特開 2004-193238 (P2004-193238A)
【公開日】平成 16 年 7 月 8 日 (2004.7.8)
【年通号数】公開・登録公報 2004-026
【出願番号】特願 2002-357620 (P2002-357620)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/02

【F I】

H 0 1 L 21/02 Z

【手続補正書】
【提出日】平成 17 年 6 月 1 日 (2005.6.1)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

半導体製造装置内部のヒータが収納されているヒータ室内の熱を排気可能な熱排気ダンパを有する半導体製造装置において、
前記熱排気ダンパは熱排気量を変化させることが可能であり、
前記半導体製造装置内の温度を測定可能な温度センサにより測定された温度測定データやあらかじめレシピ内に書き込まれているレシピ情報に基づき、前記熱排気ダンパの熱排気量を制御する熱排気ダンパ制御装置を備えることを特徴とする半導体製造装置。